

三次元半導体研究センター

機器利用料金について

(公財)福岡県産業・科学技術振興財団

各料金について

- 基本料金: クリーンルーム室料 2,500円/日・人
クリーンルーム以外室料 1,000円/日・人
 - ① 上記の金額に、使用日数を乗じる
 - ② 複数の者が使用する場合は、①にその人数を乗じる
 - ③ 併用して使用する場合は、合算した金額
- 機器利用料: 各機器の時間単価(別紙1)に利用時間を乗じる
- 工賃: 別紙2のとおり
- 基本料金+機器利用料+工賃(必要な場合のみ)+消費税を請求

三次元半導体研究センター 機器利用料金単価表(H29.10.1改定)

時間単価、税抜

No.	機器名	設置場所	料金
1	基板クランプ機構付き真空式ロールコーター	クリーンルームB	4,600
7	ソルダーレジスト乾燥炉	クリーンルームB	2,400
9	予熱ラミネーター	クリーンルームB	2,400
11	クリーンローラ	クリーンルームB	1,700
12	フィルムレジスト圧着装置	クリーンルームB	5,400
21	プリント基板用直接描画装置	クリーンルームB	22,500
23	エッチング処理後乾燥炉	クリーンルームB	2,000
30	プリント基板用プラズマクリーナー	クリーンルームB	6,100
33	AOI(光学式外観検査装置)	クリーンルームB	10,700
73	パーティクルカウンター	クリーンルームB	600
56	半導体試験装置	クリーンルームC	12,900
66	マイクロフォーカスX線透視装置	クリーンルームC	3,200
43	ガラス(支持)基板貼合せ装置	クリーンルームD	4,900
44	ガラス(支持)基板剥離装置	クリーンルームD	7,600
45	照射器移動方式紫外線照射装置	クリーンルームD	2,200
46	オートマチックサーフェスグラインダー	クリーンルームD	10,700
48	オートマチックダイシングソー	クリーンルームD	7,000
49	ストレスリリーフ装置	クリーンルームD	9,500
47	8インチ用ウェハマニュアル洗浄装置	クリーンルームE	2,800
53	ウェハーカップ式銅メッキ装置	クリーンルームE	13,500
55	半導体用クリーンルーム対応リフロー炉	クリーンルームE	7,500
69	超純水製造装置	クリーンルームE	600
50	リアクティブイオンエッチャー	クリーンルームF	15,000
51	絶縁膜形成装置	クリーンルームF	14,000
52	縦型酸化炉	クリーンルームF	7,500
54	超小型蒸着装置	クリーンルームF	5,500
65	電界放出型分析走査電子顕微鏡システム	クリーンルームF	12,400
67	光学顕微鏡	クリーンルームF	1,400
68	実体顕微鏡	クリーンルームF	2,700
40	微細パターン加工装置	クリーンルームG	16,500
41	スピコーター	クリーンルームG	4,000
42	アルカリデベロッパ	クリーンルームG	4,600
14	アンダーフィル塗布機	実装エリア	1,300
15	メタルマスク洗浄装置	実装エリア	1,300
16	プリント基板用高速スクリーン印刷機	実装エリア	4,500

No.	機器名	設置場所	料金
17	プロダクションモジュラー	実装エリア	5,200
18	導通試験テストデータ加工データ作成装置	実装エリア	3,600
19	大型基板対応フリップチップボンダ	実装エリア	12,000
24	鉛フリー対応N2リフロー装置	実装エリア	5,000
26	真空密閉型超音波洗浄装置	実装エリア	4,100
32	内蔵部品検査装置	実装エリア	7,900
13	基板処理前乾燥炉	水平ライン室	2,400
27	基板用現像装置	水平ライン室	9,300
28	ソフトエッチ水洗装置	水平ライン室	7,700
29	レジスト剥離装置	水平ライン室	12,700
31	基板用ケミカルエッチング装置	水平ライン室	10,900
25	基板用パフ研磨装置	めっきライン室	7,500
34	積層前粗化处理装置	めっきライン室	9,900
35	デスミア装置	めっきライン室	12,400
36	基板用無電解めっき装置	めっきライン室	10,300
37	電解ビアフィルめっき装置	めっきライン室	10,600
3	プリント基板用X線ガイド穴明機	機械加工室	5,000
4	プリント基板穴明機	機械加工室	5,700
5	プリント基板外形加工機	機械加工室	4,600
8	ピン立て装置	機械加工室	2,500
20	プリント配線板用UV+CO2レーザ加工機	機械加工室	15,000
60	恒温恒湿振動試験機	信頼性試験室	7,300
61	衝撃試験装置	信頼性試験室	7,500
62	自動切断機	信頼性試験室	900
63	自動研磨機(64 研磨濾過器含む)	信頼性試験室	3,400
57	プロービングシステム	電気特性評価室	2,600
58	高周波パラメータ測定システム	電気特性評価室	11,000
59	TDRオシロスコープ	電気特性評価室	4,800
74	基板パラメータ測定システム	電気特性評価室	2,100
2	プリント基板真空プレス装置	プレス室	9,900
38	自動滴定分析機	分析室	900
39	CVS	分析室	2,900
L1	レーザー顕微鏡	検査室	3,800
L2	フリップチップボンダー	クリーンルームC	10,800
L3	ワイヤーボンダー	クリーンルームC	5,700
L4	ボンドテスタ	クリーンルームC	3,200
L5	FIB	クリーンルームC	12,500
L7	ウエハープラズマクリーナー	クリーンルームC	4,500
L8	酸化膜エッチング装置	クリーンルームC	8,300

三次元半導体研究センター 工賃・技術料について(H29.10.1改定)

●技術工賃単価

・下記の操作サポート及び受託^{*}を除き、36,000円/時

※受託は原則として実施しないが、実施する場合は78,000円/時

・従来の技術料は廃止

●操作サポート工賃単価

以下の機器については、操作方法の補助のみの場合、20,000円/時とする。

No.	機器名	設置場所
7	ソルダーレジスト乾燥炉	クリーンルームB
9	予熱ラミネーター	クリーンルームB
11	クリーンローラ	クリーンルームB
23	エッチング処理後乾燥炉	クリーンルームB
30	プリント基板用プラズマクリーナー	クリーンルームB
33	AOI(光学式外観検査装置)	クリーンルームB
56	半導体試験装置	クリーンルームC
66	マイクロフォーカスX線透視装置	クリーンルームC
14	ボンドテスタ	クリーンルームC
43	ガラス(支持)基板貼合せ装置	クリーンルームD
44	ガラス(支持)基板剥離装置	クリーンルームD
45	照射器移動方式紫外線照射装置	クリーンルームD
47	8インチ用ウェハマニュアル洗浄装置	クリーンルームE
67	光学顕微鏡	クリーンルームF
68	実体顕微鏡	クリーンルームF
17	ウェハープラズマクリーナー	クリーンルームG
11	レーザー顕微鏡	検査室
25	基板用バフ研磨装置	めっきライン室
3	プリント基板用X線ガイド穴明機	機械加工室
8	ピン立て装置	機械加工室
16	プリント基板用高速スクリーン印刷機	実装エリア
26	真空密閉型超音波洗浄装置	実装エリア
32	内蔵部品検査装置	実装エリア
60	恒温恒湿振動試験機	信頼性試験室
61	衝撃試験装置	信頼性試験室
62	自動切断機	信頼性試験室
63	自動研磨機(64 研磨濾過器含む)	信頼性試験室
110	マイグレーション評価装置	信頼性試験室
18	導通試験テストデータ加工データ作成装置	研究員室